**H30年度 総合地球環境学研究所 同位体環境学共同研究 承諾書**

平成　　　年　　　月　　　日

総合地球環境学研究所　所長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　申請者（研究代表者※）の所属

　　　　　　　　　　　　　　 　 職 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　電話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail アドレス

同位体環境学共同研究事業公募要領の記載事項および下記の内容に同意のうえ、貴研究所で研究することを承諾します。

※大学または研究機関に所属する研究者の方の研究活動であることを誓約します。

**研 究 題 目**※研究内容がわかるように具体的なテーマと記入して下さい。

**研 究 期 間**平成　　年　　月　　日　　～　平成　　年　　月　　日

**研 究 組 織**（様式２-２に記載して下さい）

申請者が貴研究所において研究に従事することを承諾します。

平成　　　年　　　月　　　日

申請者の所属長　職・氏名

印

**研究組織一覧　（地球研実験施設を使用される共同研究者の氏名を下表に記入してください）**

■研究者（常勤・非常勤職員、学振特別研究員（PD,、DC1、DC2を問わない）、COE研究員、教務補佐員等）の方は、お名前の右肩に丸印を付けてください。

■装置名および認定資格欄では、地球研実験施設を利用される方全員の装置利用経験、および資格認定取得の有無を確認します。申請書（別紙・様式１または様式４）に記載されている利用予定装置について、当研究所の共通機器利用の資格認定を取得されている方は、表の下部にある装置名称を参照の上ご記入をお願いします。実験施設および装置を全く利用した経験が無い方も、その旨わかるよう以下の欄を記入してください。

※学生及び大学研究者に準じる方

共同研究開始までに，「学生教育研究災害傷害保険」又は同等以上の傷害保険に加入することを誓約します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **所属（職または学年も）** | **装置名** | **認定資格**（該当する項目以外は削除してください） |
| **氏名** |  | **他機関での同装置利用経験の有無** |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |
|  |  | 管理者 ・ 上級 ・ 一般 ・ 資格無 |
|  | 他機関での同装置利用経験：有 ・ 無 |

平成　　　年　　　月　　　日

申請者の所属・職名・氏名

印

（記入例）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **所属（職または学年も）** | **装置名** | **認定資格**（該当する項目以外は削除してください） |
| **氏名** |  | **他機関での同装置利用経験の有無** |
| 教授 | マルチコレクターICP-MS (NEPTUNE) | 管理者 |
| 地球　研一郎○ | 他機関での同装置利用経験： 有 |
| 修士課程　1年 | 誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS) | 一般 |
| 上賀茂　さくら | 他機関での同装置利用経験：無 |

共通機器についてはHP（http://www.chikyu.ac.jp/laboratories/labo\_shisetsu\_top.html）をご覧ください。

　※共通機器名称：

走査型電子顕微鏡(SEM)

マイクロダイセクター

微少量試料掘削回収装置(マイクロミル)

多機能型顕微鏡 デジタルマイクロスコープ

水銀分析装置

マイクロ波試料前処理装置

ガンマ(γ)線スぺクトロメーター

表面電離型質量分析装置 (TRITON)

マルチコレクターICP-MS (NEPTUNE)

誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS)

軽元素安定同位体比測定用質量分析装置（CN-IRMS）

軽元素安定同位体比測定用質量分析装置（炭酸塩-IRMS）

軽元素安定同位体比測定用質量分析装置（有機物OH-IRMS）

軽元素安定同位体比測定用質量分析装置（S-IRMS）

ICP発光分光分析装置

水同位体分析装置(Picarro L2120-i、Picarro L2130-i)

イオンクロマトグラフィー装置

低温灰化装置

試料微粉砕装置

試料粉砕装置ミキサーミル

試料切断研磨装置